

P C T

国際予備審査報告

24 SEP 2004

(法第12条、法施行規則第56条)
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 T 0 3 0 2 - P C T	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ I P E A / 4 1 6）を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 3 / 0 3 6 4 5	国際出願日 (日.月.年) 2 5 . 0 3 . 2 0 0 3	優先日 (日.月.年) 2 5 . 0 3 . 2 0 0 2
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. A 4 7 G 1 / 0 4 , A 4 7 B 6 7 / 0 2 , A 4 7 K 1 / 0 2		
出願人 (氏名又は名称) 東陶機器株式会社		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で 4 ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
 - ☒ 国際予備審査報告の基礎
 - ☐ 優先権
 - ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 - ☐ 発明の単一性の欠如
 - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - ☐ ある種の引用文献
 - ☐ 国際出願の不備
 - ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 1 7 . 0 7 . 2 0 0 3	国際予備審査報告を作成した日 1 9 . 0 4 . 2 0 0 4	
名称及びあて先 日本国特許庁 (I P E A / J P) 郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 富江 耕太郎	3 R 9 5 3 2
電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 8 4		

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-8 ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 ページ、 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 8, 9 項、 24.03.2004 付の書簡と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 10-18 項、 26.12.2003 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-5 ~~ページ/図~~、 出願時に提出されたもの
 図面 第 ~~ページ/図~~、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 6, 7 ~~ページ/図~~、 26.12.2003 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 ページ、 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 1-7 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲 8-18 有
請求の範囲 無

進歩性 (IS)

請求の範囲 8-18 有
請求の範囲 無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 8-18 有
請求の範囲 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲8-18に係る、化粧鏡ユニットにおいて、左右の袖鏡を合わせた状態で使用者に向かってせり出して使用する際に、必要以上に袖鏡を主鏡側に移動することを抑制できるように回転角度に節度を持たせる構成は、国際調査報告に引用されたどの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

CLAIMS

1. A makeup mirror unit comprising:
a cabinet body;
a main mirror provided in a substantially central portion of the front surface of the cabinet body;
a rack portion provided at least in one side of the main mirror; and
a sub mirror which covers the rack portion,
wherein a frame is fixed in a portion of the front surface of the rack portion, which is near to the main mirror, so as to freely rotate in a horizontal direction, and the sub mirror is fixed to the outer end of the frame so as to freely rotate in a horizontal direction.
2. The makeup mirror unit according to claim 1, wherein the frame has a C shape comprising a vertical member, an upper horizontal member and a lower horizontal member, and the vertical member is positioned in the end which is near to the rotation center of the sub mirror.
3. The makeup mirror unit according to claim 1, wherein a hinge is provided for fixing the frame to the cabinet body so as to freely rotate, and the rotation axis of the hinge is located at a position of overlapping with the sub mirror in a closed state from a plan view or at a forward position thereto.
4. The makeup mirror unit according to claim 1, wherein a seat of a hinge for fixing the frame and the sub mirror is clamped to a back surface of the frame, and the other seat of the hinge is clamped to the back surface of the sub mirror.

5. The makeup mirror unit according to claim 1, wherein a seat of a hinge for fixing the frame and the sub mirror is integrally formed with the frame, and a seat of a hinge for fixing the frame to the cabinet body is integrally formed with the frame.
6. The makeup mirror unit according to claim 1, wherein the sub mirror is provided in both ends of the main mirror, and a simple coupling member including a magnet, a sheet fastener, or a hook is provided in the ends of the sub mirrors near to the main mirror so as to couple the sub mirrors.
7. The makeup mirror unit according to claim 1, wherein a rack portion for small goods is provided in the back surface of the sub mirror, which utilizes the thickness of the frame.

FIG. 6

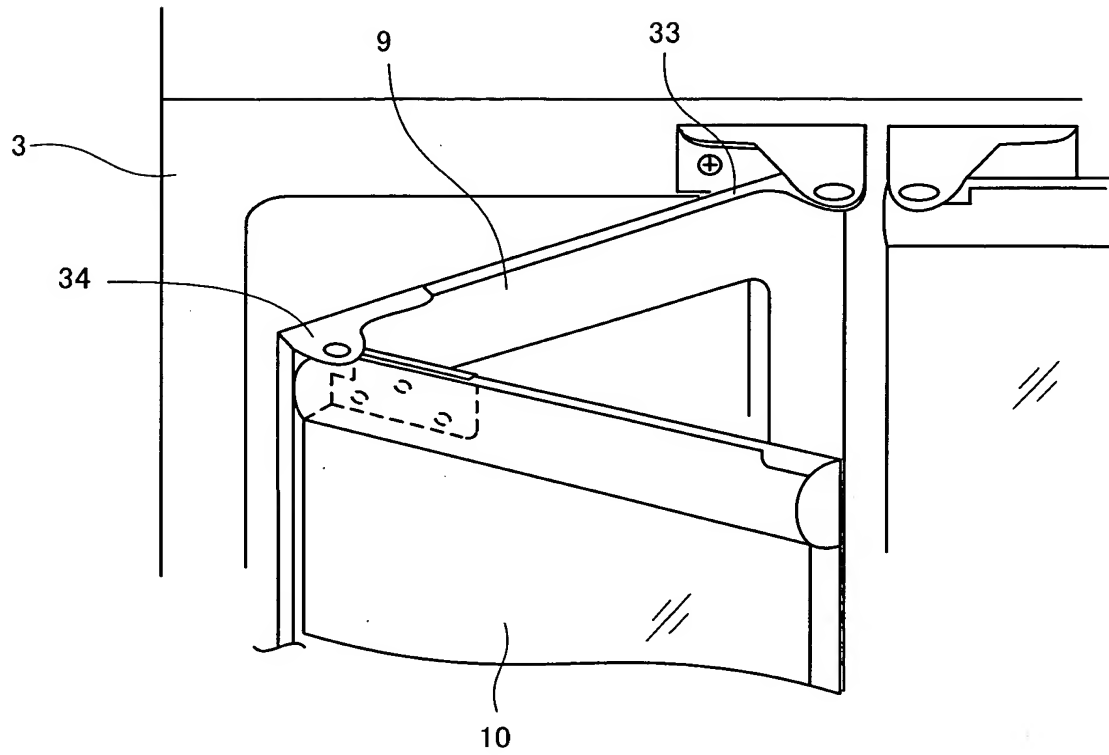
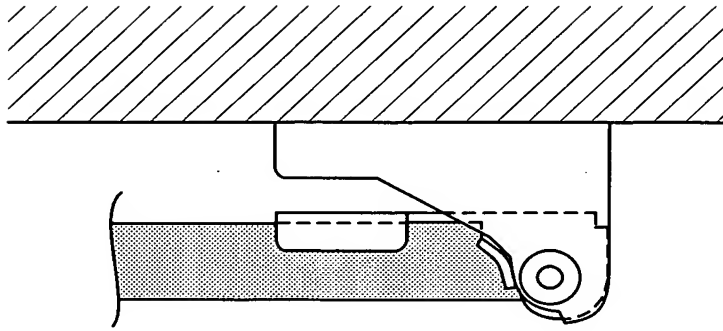
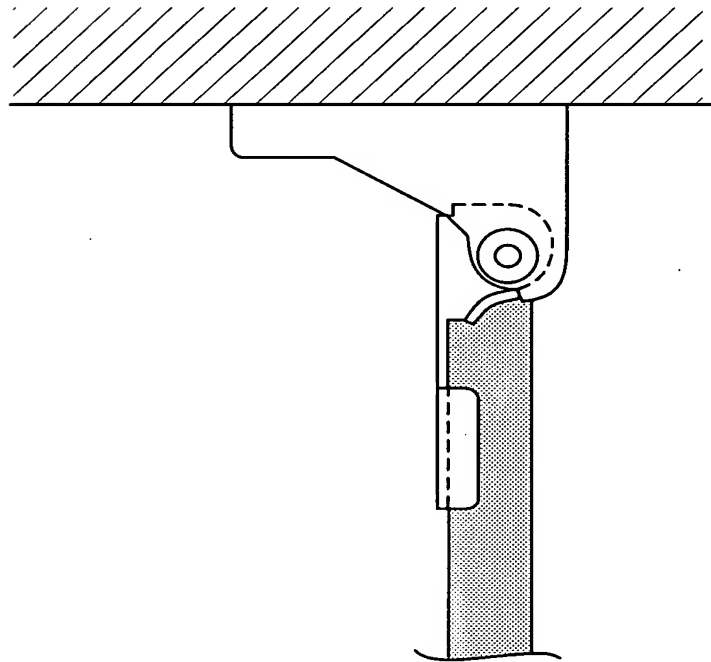


FIG. 7

(a)



(b)



BEST AVAILABLE COPY